

知的財産権(Intellectual Property Rights)

担当教員名	森定 勇二	
学科・専攻, 科目詳細	電気情報工学科 電気電子工学コース 5年 前期 1単位 講義	
学科のカリキュラム表	専門科目 必修科目	
共生システム工学の科目構成表	基礎工学科目 社会技術系	
学習・教育目標	共生システム工学	A-2(20%) D-2(80%)
	JABEE基準1(1)	(a) (d) (e)
科目の概要	①知的財産権基礎理論(特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・その他)②研究者・開発者の知的財産管理方法論(特許権を中心とする)③出願手続きフロー等(出願から登録まで及び登録後の流れを解説)④外国出願手続きフロー等(PCT国際特許出願制度を中心に各機関と出願後の流れについて解説)⑤知的財産権の調査関連:講義及び実習(特許・実用新案・意匠・商標の調査の目的、調査ツールについて解説。インターネット経由のJ-PlatPatを利用して検索実習も行う予定)	
テキスト(参考文献)	産業財産権標準テキスト特許編第8版 [参考文献は講義中にて紹介する]	
履修上の注意	自分自身又は友人・知人等が研究開発した創作(発明等)があると仮定し、その創作を如何に保護するか及び権利化を図るかという臨場感を持って講義に臨んで欲しい。 日頃から知的財産権関係のニュースなどに関心を持ち考える習慣を身につけること。	
科目の達成目標	①わが国及び外国の知的財産権の制度を理解するとともに、他者に説明できる能力を取得する。 ②大学内又は企業内で研究・開発担当者となった場合に、組織内で適切な知財管理能力を発揮できる知識を身につけるとともに、組織内で主導できる能力を取得する。 ③出願手続き(国内及び外国)の流れを理解し、弁理士あるいは特許庁(関係機関)とのコミュニケーションの際、どの段階の手続きであるかを理解できる能力を取得する。 ④調査の重要性を理解し、自らすべての調査をおこなうべきかそれとも専門家に依頼すべきかの判断ができる能力を養う。また、自らが必要な調査ができるコンピュータリテラシーを獲得する。	
自己学習	目標を達成するためには、授業時間以外に行う予習・復習の実施が必要である。	
目標達成度(成績)の評価方法と基準	合格の対象としない欠席条件(割合)	1/3以上の欠課
	成績は上記の学習目標の達成度を、定期試験(100%)の結果を評価し、総合評価が60%以上を合格とする。 定期試験では、上記の達成目標①、②、③、④の達成度を評価する。	
連絡先	office@morisada.asia,kami@akashi.ac.jp	

授業の計画・内容	
第1週	知的財産権の概要 知的財産権の概観を俯瞰し、アウトラインを示す。
第2週	特許Ⅰ 特許制度の概要、目的、特許（登録）要件等について講義する。
第3週	特許Ⅱ 新規性及び進歩性の判断について講義する。
第4週	特許Ⅲ アイデアから広く・強い特許発明を創作するプロセスについて講義する。
第5週	特許Ⅳ 手続きの流れ及び職務発明について講義する。
第6週	特許Ⅴ・国際特許出願制度／外国の特許制度 特許の調査について、外国に特許出願する必要性等について講義する。
第7週	特許Ⅵ 特許の調査について講義及び実習をする。※パソコン実習室の予定。
第8週	中間試験 中間試験を実施する
第9週	中間試験の解説及び講評・意匠権Ⅰ 特許・実用新案についてまとめを行う。意匠登録制度の概観について講義する。
第10週	意匠Ⅱ 意匠登録制度の目的、登録要件、特殊な意匠登録について講義する。
第11週	商標 商標登録制度の目的、登録までの流れ、商標権侵害等について講義する。
第12週	著作権Ⅰ 著作権法の概要（著作物、著作者・著作権者、著作者人格権・著作権等）について講義する。
第13週	著作権Ⅱ 他人の著作物を利用する場合の注意点、職務著作等について講義する。
第14週	不正競争防止法・意匠又は商標の調査 知的財産権を補完する不正競争防止法について講義する。 意匠又は商標の調査について講義及び実習を行う。※パソコン実習室の予定。
第15週	知的財産権のまとめ 知的財産権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権）相互間の違いについて講義まとめる。
期末試験	